



光学式三次元測定器 OPS-1000

- ・最小受光感度 100 dB、ダイナミックレンジ 70 dB
- ・最大 40 万点/秒の高速測定可能
- ・同軸計測により複雑な形状でも容易に測定可能

研究・開発に最適な光応用製品

! New !



ウエハ厚分布測定器

TMS-2000

! New !



波長掃引型
フォトリソグラフィアナライザ

SPA-100

- ・光ヘテロダイン干渉方式による高精度計測（くり返し測定精度 ≤ 1 nm）
- ・グローバル、サイト、エッジ平坦度解析が可能
- ・高い耐環境性
- ・小型で配置場所を選ばない省スペース設計
- ・高スループット
- ・OFDR 技術を用いた光路長 & 損失分布解析システム
- ・反射点計測：高い分解能 $5 \mu\text{m}$
- ・波長依存損失計測：広いダイナミックレンジ 70 dB
- ・近接センシング：ファイバプローブとデバイス間の距離測定



皆様のご研究にお役立ていただける
弊社製品のラインナップをウェブ
サイトにも掲載しています。

製品情報の詳細は裏面をご覧ください

研究・開発に最適な光応用製品



■ 波長可変レーザー

ハイエンドモデル TSL-770



波長可変範囲 1480 to 1640 nm
波長精度 0.5 pm、最大パワー +13 dBm
スペクトル線幅 60 kHz、周波数ゆらぎ 従来比 1/10 以下

スタンダードモデル TSL-570



ご用途に合わせた波長帯や波長精度を選択可能
最速 200 nm/s で全域モードホップフリー掃引
波長精度 3 pm \sim 、最大パワー +13 dBm

ハイパワーモデル TSL-570 Type H



最大パワー +20 dBm
波長可変範囲 1260 to 1360 nm or 1500 to 1630 nm
シリコンフォトリソグラフィなどの評価用光源に最適

超広帯域のフルバンドモデル Full-band TSL



波長可変範囲 1260 to 1680 nm (O to U-band)
100 nm/s 波長掃引可能
オペレーションソフトウェア付属

ステップ可変エコノミーモデル WSL-110



最大 2 台のレーザーを搭載可能 (C or L-band)
任意波長に設定可能

高速波長掃引型 VCSEL タイプ HSL-1



MEMS 技術と VCSEL 技術を融合
中心波長 1060 nm、掃引速度可変 10 to 400 kHz
LIDAR などのセンシング用光源に最適

高速波長掃引型 MEMS タイプ HSL-10/20



SS-OCT 用スタンダード光源
中心波長 1060 nm or 1310 nm
スキャンレンジ \geq 105 nm

■ LCOS 型空間光変調器

ハイスピードモデル SLM-210



反射型 LCOS で光の位相を自由に変調
Full-HD 解像度、10-bit (1024 階調)
優れた位相安定度 ($\sim 0.002\pi$ rad)

紫外線耐性モデル SLM-250



液晶及び光学薄膜構造を耐紫外線に最適化
波長範囲 365 to 550 nm

高出力耐性モデル SLM-300



液晶及び放熱構造を耐高出力レーザーに最適化
対応波長 532 nm、800 nm、1064 nm

■ 光スイッチ

1xN、2xN メカニカルモデル OSX-100



超低損失 <0.5 dB
高い再現性 ± 0.005 dB
最大 400 ch まで対応可能

■ 光アッテネータ

標準モデル OVA-100



高いダイナミックレンジ 100 dB
アッテネーション設定精度 ± 0.1 dB
高い再現性 ± 0.01 dB

■ 光学特性検査システム

スイープテストシステム

波長可変レーザー TSL シリーズ
マルチポートパワーメータ MPM シリーズ
偏波コントローラ PCU-110
マルチプランチユニット MBU



IL/WDL/PDL の効率的な測定を実現
分岐ユニットにより更なる検査・評価の効率化が可能
オペレーションソフトウェア付属

■ 波長可変フィルタ

フィルタ形状可変 Top flat タイプ OTF-980



透過波長と帯域幅を可変
非常に急峻なフィルタスロープ 1000 dB/nm
エコノミーモデル (OTF-350 手動可変) も用意

フィルタ形状 Gaussian タイプ OTF-930



豊富なフィルタ種類ラインアップ
低 PDL (< 0.1 dB) & 低 PMD (< 0.1 ps)
エコノミーモデル (OTF-320 手動可変) も用意

スペクトル整形器 WSS-2000



プログラム可能な任意スペクトルの整形
高分解能な波長及び帯域可変制御設定分解能: 0.78125 GHz
急峻なフィルタスロープ 400 dB/nm (typ.)
スイッチング機能オプション 1, 2 または 4 出力

■ 偏波測定

偏光消光比モニタ PEM-340



偏光消光比、偏光角度、光強度を同時測定
最大 50 dB までの消光比をリアルタイムに測定可能
広い光入力範囲 (-40 to +20 dBm / 1260 to 1630 nm)

高消光比光源 PLS-100



0 から 180 度の間で偏光軸の角度を可変
45 dB (代表値) の高消光比
PMF デバイスの PER 測定に最適

■ 計測システム

波長掃引型フォトリソグラフィ SPA-100



OFDR 技術を用いた光路長 & 損失分布解析システム
・反射点計測: 高い分解能 5 μ m
・波長依存損失計測: 広いダイナミックレンジ 70 dB
・近接センシング: ファイバプローブとデバイス間の距離測定

光学式断層測定 (OCT) IVS シリーズ



波長掃引型 OCT (Swept-Source OCT) システム
物の内部を非接触、非破壊、非侵襲で見ることが可能
最大 30 fps のリアルタイム・イメージング

光学式三次元測定 OPS-1000



ダイナミックレンジ 70 dB 超高感度 3D プロファイラー
高分解能 0.2 μ m \sim
形状、材料、色、表面、外乱光の状態を問わず、
非接触・高速測定が可能

■ 光パワーメータ

ベンチトップ型ハイエンドモデル OPM-200



広い波長範囲 840 to 1700 nm
高いダイナミックレンジ -80 to 8 dBm
ハイパワーモデル (-50 to 27 dBm) も用意

www.santec.com